

688748-2026 - Konkurrencevilkår

Schweiz – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de MicroNanoTechnologie

OJ S 193/2026 06/10/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Varer

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: EPFL-Scientific Equipment

E-mail: jerome.butty@epfl.ch

Køberens retlige status: Offentligretligt organ

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Uddannelse

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de MicroNanoTechnologie

Beskrivelse: L'EPFL a l'intention d'acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi est une installation de salles blanches dédiée à la micro/nano fabrication, centrale pour l'ensemble des facultés de l'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano fabrication, et plus particulièrement à la gravure de couches de Chrome déposées sur des masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera accordée non seulement à la qualité des gravures, mais également à comment les contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé pour la flexibilité d'usage prévue pour cet équipement. La facilité d'utilisation de l'équipement, sa simplicité/rapidité d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais néanmoins robuste capacité de contrôle de procédés de gravure dans un environnement type R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le support disponible (technique, procédés) seront évalués.

Identifikator for proceduren: 16fee67d-11ee-4550-bd8f-a43ef8582e0d

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2.1.2. Udførelsessted

By: Lausanne

Postnummer: 1015

Landsdel (NUTS): Vaud (CH011)

Land: Schweiz

2.1.4. Generelle oplysninger

Yderligere oplysninger: Autres exigences - Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre hommes et femmes. - Les entreprises intéressées doivent s'inscrire sur le serveur www.simap.ch et télécharger elles-mêmes le cahier des charges et ses annexes, à la même adresse. - L'acquisition se fera sous réserve de l'avancement du projet et de la disponibilité des crédits. - Afin de garantir l'actualité de l'information et l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, seuls les documents remis après la date de publication de l'appel d'offres sur le serveur www.simap.ch seront pris en considération dans l'évaluation des offres.

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de MicroNanoTechnologie

Beskrivelse: L'EPFL a l'intention d'acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi est une installation de salles blanches dédiée à la micro/nano fabrication, centrale pour l'ensemble des facultés de l'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano fabrication, et plus particulièrement à la gravure de couches de Chrome déposées sur des masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera accordée non seulement à la qualité des gravures, mais également à comment les contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé pour la flexibilité d'usage prévue pour cet équipement. La facilité d'utilisation de l'équipement, sa simplicité/rapidité d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais néanmoins robuste capacité de contrôle de procédés de gravure dans un environnement type R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le support disponible (technique, procédés) seront évalués.

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

Valgmuligheder:

Beskrivelse af optioner: Voir cahier des charges.

5.1.2. Udførelsessted

By: Lausanne

Postnummer: 1015

Landsdel (NUTS): Vaud (CH011)

Land: Schweiz

5.1.3. Anslået varighed

Anden varighed: Ukendt

5.1.4. **Fornyelse**

Højeste antal fornyelser: 0

5.1.6. **Generelle oplysninger**

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives: Endnu ikke kendt

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. **Udvælgelseskriterier**

Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. **Tildelingskriterier**

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Critères d'adjudication

Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier: Les critères d'adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. **Tilbudsdokumenter**

Adgangen til visse udbudsdokumenter er begrænset

Oplysninger om begrænsede dokumenter findes på: <https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ>

Ad hoc-kommunikationskanal:

Navn: Simap.ch

5.1.12. **Tilbudsvilkår**

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Tilladt

Indgivelsesadresse: <https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: engelsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 12/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 160 Døgn

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Endnu ikke kendte

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Plus d'informations dans la publication officielle sur simap.ch

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

Oplysninger om finansiering og betaling: Plus d'informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif fédéral

Oplysninger om klagefrister: Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas.

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: EPFL-Scientific Equipment

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: EPFL-Scientific Equipment

Registreringsnummer: 592b5d3c-c54e-4d61-a5eb-3ad0bb962925

Postadresse: EPFL AVP-CP ECO BI A2 447 (Bâtiment BI) Station 7

By: Lausanne

Postnummer: 1015

Landsdel (NUTS): Vaud (CH011)

Land: Schweiz

E-mail: jerome.butty@epfl.ch

Telefon: +41216931111

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Tribunal administratif fédéral

Registreringsnummer: BVGER

Postadresse: Postfach

By: St. Gallen

Postnummer: 9023

Landsdel (NUTS): St. Gallen (CH055)

Land: Schweiz

E-mail: info@bvger.admin.ch

Telefon: +41584652626

Internetadresse: <https://www.bvger.ch>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Simap.ch
Registreringsnummer: CH001
Postadresse: Holzikofenweg 36
By: Bern
Postnummer: 3003
Landsdel (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Land: Schweiz
E-mail: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetadresse: <https://www.simap.ch>
Denne organisations roller:
TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: c2992473-dbe1-4f6b-b658-8054d08e4e61 - 01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 03/10/2026 02:25:50 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: fransk, tysk
Bekendtgørelsesnummer: 688748-2026
EUT-S-nummer: 193/2026
Offentliggørelsesdato: 06/10/2026